

半導體設備-失效分析儀

冷熱台（變溫、電測、拉伸）

探针光学冷熱台



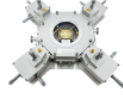
支持与各类显微镜、光谱仪等光学仪器设备联用，进行变温下的光学观察及测试。支持与各类电测测试系统，如蓝电测试系统、源表等进行电学测试。
温度范围：-190~600°C / RT~1200°C
实验环境：气密 / 真空环境/湿度环境/氩气/氮气/氧气等实验环境。

电镜SEM原位冷熱台



适用于电镜中需要变温条件的样品在扫描电子显微镜中进行高低温结构研究，适配电镜内部位移台。
温度范围：-190~200°C / RT~650°C。
实验环境：低真空/高真空电镜腔室。

外置调节探针冷熱台



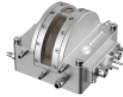
配蓝电测试系统，源表等需要重复选取样品位置的温度及光学测试。
温度范围：-190~600°C / RT~1000°C
实验环境：气密 / 真空环境/湿度环境/氩气/氮气/氧气等实验环境。

SEM原位拉伸台



适用电镜内部定量分析材料微观力学性质、相变行为、取向变化、裂纹萌生和扩展、材料断裂、材料弯曲、分层、滑移面以及脱落以及形变、相变过程中的力学性能等。
温度范围：-185~200°C
实验环境：低真空/高真空电镜腔室。

xrd冷熱台



适用于各种样品类型在高低温下进行 X-射线结构研究，多种样品架可配合反射和透射模式，支持在现有各种X-射线衍射仪（布鲁克、赛默飞、理学等）上改造适配。
温度范围-190°C ~ 600°C, RT~1200°C
实验环境：气密 / 真空环境/湿度环境/氩气/氮气/氧气等实验环境。

超高温冷熱台



支持与各类显微镜、光谱仪等光学仪器设备联用，进行变温下的光学观察及测试。
温度范围：-190~600°C / RT~1200°C
实验环境：气密 / 真空环境/湿度环境/氩气/氮气/氧气等实验环境。

失效分析設備-ESD/TLP測試儀

Hanwa HCE-5000 小型ESD测试仪



- ①便携式ESD测试机，满足HBM/MM测试；满足JEDEC/ESD A/AEC/JEITA标准
- ②嵌入式操作屏幕，内置SMU，无需外接SMU及PC即可进行测试
- ③具备独立上位机操作软件，进行数据采集，Leakage曲线绘制追踪；多种测试夹具（可拓展）选择

Hanwa HED-G5000 全自动测试机



- ①搭载多Pin脚无继电器（最高2048pin）结构，支持HBM/MM/Latch-up测试模型；适应以下国际标准波形：JEDEC，ESDA，AEC和JEITA。
- ②利用机械式GND开关，保证测试速度的前提下，避免了传统继电器结构导致的寄生效应，测试更精确；多组Bias电源任意搭配选择。

Hanwa HED-C5000R全自动CDM测试仪



- ①CDM测试机，1024pin，全自动测试机
- ②满足JEITA/ESDA/JEDEC/AEC测试标准
- ③兼容FI-CDM，D-CDM测试

Hanwa HED-T5000高性能TLP



- ①TLP及VF-TLP，多种脉宽、上升沿以及量程选择，可定制
- ②满足ANSI/ESD测试标准，灵活匹配多种ESD测试模型
- ③可搭载电源进行SOA测试，操作软件一键设置，自动测试
- ④IV曲线绘制，leakage曲线追踪；多种测试夹具，可搭载自动探针台进行自动测试

Hanwa HED-S5000R全自动测试机



- ①低pin ESD测试机，可选128/256pin，支持HBM/MM/Latch-up测试模型；适应以下国际标准波形：JEDEC，ESDA，AEC和JEITA
- ②利用机械式GND开关，保证测试速度的前提下，避免了传统继电器结构导致的寄生效应，测试更精确；多组Bias电源任意搭配选择

Hanwa HED-W5000M晶圆级测试仪



- ①可进行HBM/MM/HMM的wafer level以及package level测试
- ②满足测试标准JEDEC/ESDA/JEITA/AEC
- ③可搭载自动探针台进行全自动测试；曲线绘制追踪，为研发提供全方位保障

失效分析設備



激光开封机



化学开封机



EMMI微光显微镜



锁相红外显微镜



红外显微测温系统



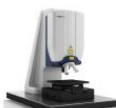
场发射电镜



双束系统FIB



TDR高精度时域测试仪



MEMS面振四维测试系统



光学/激光显微镜



研磨机



推拉力测试仪



Xray扫描仪



声学扫描仪



IV曲线自动测量仪

